



(43) 國際公開日
2005 年 7 月 14 日 (14.07.2005)

PCT

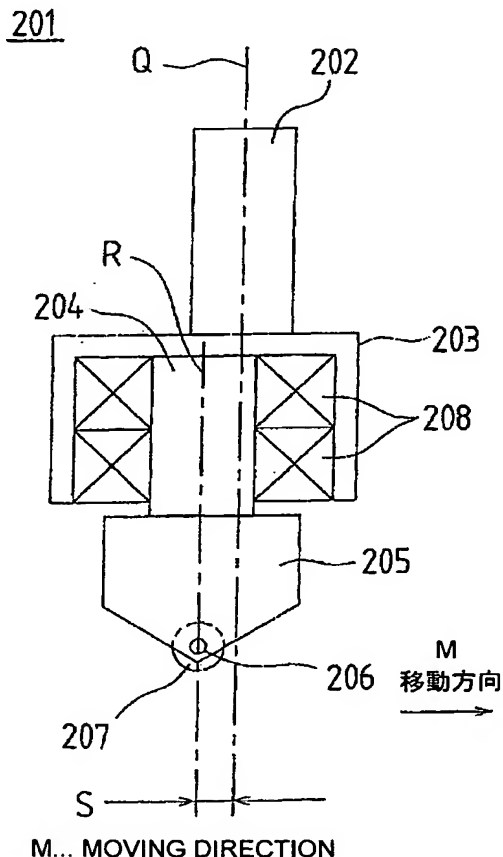
(10) 国際公開番号
WO 2005/063459 A1

- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| (51) 国際特許分類 ⁷⁾ : | B28D 5/02, C03B 33/027, 33/10 | INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹田市南金田 2 丁目 1 2 番 1 2 号 Osaka (JP). |
| (21) 国際出願番号: | PCT/JP2004/019654 | (72) 発明者; および |
| (22) 国際出願日: | 2004 年 12 月 28 日 (28.12.2004) | (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 西尾 仁孝 (NISHIO, Yoshitaka) [JP/JP]; 〒5640044 大阪府吹田市南金田 2 丁目 1 2 番 1 2 号 三星ダイヤモンド工業株式会社内 Osaka (JP). |
| (25) 国際出願の言語: | 日本語 | (74) 代理人: 山本 秀策, 外(YAMAMOTO, Shusaku et al.); 〒5406015 大阪府大阪市中央区城見一丁目 2 番 2 7 号 クリスタルタワー 1 5 階 Osaka (JP). |
| (26) 国際公開の言語: | 日本語 | (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, |
| (30) 優先権データ:
特願 2003-436932 | 2003 年 12 月 29 日 (29.12.2003) JP | |
| (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三星ダイヤモンド工業株式会社 (MITSUBOSHI DIAMOND | | |

[統葉有]

- (54) Title: SCRIBE LINE FORMING MECHANISM, SCRIBE HEAD, AND SCRIBE DEVICE**

- (54) 発明の名称: スクライブライン形成機構、スクライブヘッドおよびスクライブ装置



(57) Abstract: A scribe line forming mechanism has scribe line forming means (207) and supporting means. The scribe line forming means (207) is constructed to form a scribe line on a substrate by coming into contact with the substrate. The supporting means is means for supporting the scribe line forming means so as to be pivotable about a first pivot shaft (204) and is constructed to be pivotable about a second pivot shaft (202) different from the first pivot shaft. In the above, the axis of the first pivot shaft and the axis of the second pivot shaft are substantially parallel, and the axis of the second pivot shaft is separated by a predetermined distance from a portion where the substrate and the scribe line forming means are in contact with each other.

[統葉有]



ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明のスクライブライン形成機構は、基板に接することによって前記基板にスクライブラインを形成するように構成されたスクライブライン形成手段(207)と、前記スクライブライン形成手段を第1回動軸(204)の周りに回動可能に支持する支持手段であって、前記第1回動軸とは異なる第2回動軸(202)の周りを回動可能に構成された支持手段とを備え、前記第1回動軸の軸心と前記第2回動軸の軸心とは略平行であり、前記第2回動軸の軸心は、前記基板と前記スクライブライン形成手段とが接する部分から所定の間隔だけ離れている。